

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 高能物理研究所 / 中国科学院高能物理研究所 / 多学科研究中心

## 一种在硅衬底表面涂覆光刻胶的方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [高能物理研究所](#)

浏览

19

下载

0

收藏

0

**作者** 张天冲<sup>1</sup>; 伊福廷<sup>1</sup>; 王波<sup>1</sup>; 刘静<sup>1</sup>; 张新帅<sup>1</sup>

**发表日期** 2013-08-19

**专利号** CN103400750A

**公开日期** 2013-11-20

**源URL** [<http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/211133>]

**专题** 高能物理研究所\_多学科研究中心

**作者单位** 中国科学院高能物理研究所

**推荐引用方式** 张天冲,伊福廷,王波,等. 一种在硅衬底表面涂覆光刻胶的方法. CN103400750A. 2013-08-19.  
**GB/T 7714**

[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

[0931-8270076 发送邮件](#)

陇ICP备2021001824  
号-8

甘公网安备 62010202001088号